

日本分光学会関西支部 H26 年度 総会・講演会・見学会のご案内

主催: 日本分光学会 関西支部
共催: 大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所

開催日時: 2015 年 3 月 4 日(水) 13:00~16:00
会場: 大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス Y 号館 3 階 Y325 教室
大阪府寝屋川市初町 18-8 (〒572-8530)

◎京阪本線寝屋川市駅下車 徒歩 10 分 [急行(快速急行)停車駅]

アクセス詳細 <http://www.osakac.ac.jp/institution/campus/access/> ※「実験センター」を目指して下さい
キャンパス内地図 <http://www.osakac.ac.jp/institution/campus/neyagawa/>

【支部総会】

13:00-13:30 講演会会場にて開催いたします。関西支部会員の方はご出席ください。

【講演会】

13:40-13:45 開会挨拶

13:45-14:30 「新しい表面電子顕微鏡(LEEM/PEEM)の発展」

越川孝範(大阪電気通信大学、大阪大学、重慶大学)

低エネルギー電子顕微鏡(LEEM)・光電子顕微鏡(PEEM)はダイナミックかつその場で表面現象が観察できる新しい表面顕微鏡として注目を浴びていて、ナノテクノロジーやスピントロニクスの分野でもその成果が期待されている。講演では、まずこの新しい表面電子顕微鏡の歴史ならびに原理について紹介し、我々が得てきた成果ならびに新たに開発を進めてきた内容について報告を行う。

14:30-15:15 「高輝度・高スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡の開発とスピントロニクス薄膜材料への応用」
安江常夫 (大阪電気通信大学)

スピントロニクス薄膜材料の開発では、材料表面の磁区構造を高分解能でかつダイナミックに観察する手法が必要となる。我々は、スピン偏極低エネルギー顕微鏡(SPLEEM)で用いるスピン偏極電子ビームの偏極度と輝度を飛躍的に向上させる開発に成功し、ダイナミックな磁区観察手法を確立した。講演ではその詳細とスピントロニクス薄膜材料へ応用例について述べる。

【見学会】

15:30-16:30 講演で紹介した電子顕微鏡の他、エレクトロニクス基礎研究所の施設を見学

申込方法:

下記の連絡先まで電子メールにて氏名、所属(グループでの参加の場合は参加人数)をご連絡ください。人数把握のため出来るだけ事前申し込みをお願い致します。

申込・問合せ先:

長島 健(日本分光学会関西支部 庶務幹事)
摂南大学 理工学部 基礎理工学機構
TEL: 072-813-1167 FAX: 072-839-9186
E-mail: t-nagash@mpg.setsunan.ac.jp